

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 10 月 25 日 (2007.10.25)

【公開番号】特開 2005-136370 (P2005-136370A)
 【公開日】平成 17 年 5 月 26 日 (2005.5.26)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-020
 【出願番号】特願 2004-44030 (P2004-44030)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/31 (2006.01)

H 0 1 L 21/22 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/31 E

H 0 1 L 21/22 5 0 1 N

H 0 1 L 21/22 5 1 1 Q

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 9 月 7 日 (2007.9.7)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

基板を処理する処理室と、前記基板の主面と平行方向に位置し前記処理室を囲う第 1 の加熱手段と、前記基板の主面と垂直方向に位置し前記処理室の上方に設けた第 2 の加熱手段と前記処理室の温度を検出する第 1 の温度検出手段と、前記第 2 の加熱手段近傍の温度を検出する第 2 の温度検出手段と、前記第 1 の加熱手段と前記第 2 の加熱手段とを制御する制御装置とを有する基板処理装置において、
前記制御装置は、
第 1 の温度設定値と前記第 1 の温度検出手段が検出する温度との偏差を演算し第 1 の加算器を介して帰算処理する第 1 の制御で前記第 1 の加熱手段を制御し、
第 2 の温度設定値と前記第 2 の温度検出手段が検出する温度との偏差を演算し第 2 の加算器を介して帰算処理する第 2 の制御と前記処理室内の所定の温度での電力出力値を予め設定し該設定された出力値による第 3 の制御とを前記所定の温度で切替えて前記第 2 の加熱手段を制御することを特徴とする基板処理装置。